

お客様製汎用Cvd管状炉Cvd装置

商品番号: KT-CTF16



前書き

KT-CTF16 カスタマーメイド多用途炉であなただけの CVD

炉を手に入れましょう。カスタマイズ可能なスライド 、回転、傾斜機能により、正確な反応を実現します。 今すぐ注文!

詳細を学ぶ

炉モデル	KT-CTF16-60
最大。温度	1600°C
一定の作業温度	1550°C
炉管材質	高純度Al2O3チューブ
炉管径	60mm
加熱ゾーン	3×300mm
チャンバー材質	アルミナ多結晶ファイバー
発熱体	炭化ケイ素
加熱速度	0~10°C/分
熱電対	Sタイプ
温度調節器	デジタルPIDコントローラー/タッチスクリーンPIDコントローラー
温度制御精度	±1°C
ガス精密制御装置	
ガス精密制御装置	MFC質量流量計
	MFC質量流量計 3チャンネル
流量計	
流量計 ガスチャネル	3チャンネル MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2:0-20SCMCH4 MFC3: 0-100SCCM H2
流量計 ガスチャネル 流量	3チャンネル MFC1: 0-5SCCM 02 MFC2:0-20SCMCH4 MFC3: 0-100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
流量計 ガスチャネル 流量 直線性	3チャンネル MFC1: 0-5SCCM 02 MFC2:0-20SCMCH4 MFC3: 0-100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2 ±0.5%FS
流量計 ガスチャネル 流量 直線性 再現性	3チャンネル MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2:0-20SCMCH4 MFC3: 0-100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2 ±0.5%FS ±0.2%FS
流量計 ガスチャネル 流量 直線性 再現性 パイプラインとバルブ	MFCI: 0-5SCCM O2 MFC2:0-20SCMCH4 MFC3: 0-100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2 ±0.5%FS ±0.2%FS



標準真空ユニット(オプション)

真空ポンプ	ロータリーベーン真空ポンプ
ポンプ流量	4L/S
真空吸引ポート	KF25
真空計	ビラニ/抵抗シリコン真空計
定格真空圧力	10Pa
高真空ユニット(オプション)	
真空ポンプ	ロータリーベーンボンプ+分子ポンプ
ポンプ流量	4L/S+110L/S
真空吸引ポート	KF25
真空計	複合真空計
定格真空圧力	6×10-5Pa

上記の仕様および設定はカスタマイズ可能です

いいえ。	説明	量
1	炉	1
2	石英管	1
3	真空フランジ	2
4	チューブサーマルブロック	2
5	チューブサーマルブロックフック	1
6	耐熱手袋	1
7	正確なガス制御	1
8	バキュームユニット	1
9	取扱説明書	1